This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

- [54] Cooling element for Semiconductor Element
- [11] Japanese Patent Laid-Open Publication No: S50-94884
- [43] Opened: July 28, 1975
- [21] Application No: S49-144001
- [22] Filing Date: December 13, 1974
- [72] Inventor(s): Werner Hangs
- [71] Applicant: Siemens AG
- [51] Int.Cl.: H01L 23/34 F28F 13/00

[What is claimed is:]

Cooling element for a semiconductor element comprising:

a pillar-shaped core having semiconductor elements on one end face; and cooling fins extending from both side faces of said core, said faces facing to each other, to two planes parallel to a longitudinal axes of said core,

wherein at least some of said cooling fins are tilt with respect to the axes of said core and tilt angles of said cooling fins decrease as said cooling fins become close to the end face of the cooling element where semiconductor element is fixed.

[Brief Description of the Drawings]

Fig. 1 is a plan view of a cooling element in accordance with an embodiment of the present invention.

Fig. 2 is a sectional view of an apparatus using the cooling element shown in Fig. 1.

[Reference Numerals]

- 1. Cooling element
- 2. Core
- 2a. side face of the cooling element
- 3. Cooling fins
- 4, 6. End face of the cooling element
- 7. Longitudinal axes of the core
- 8, 9 Plane

· 7: 设先権主張 庭 (3) 西ドイツ超 1973 年12 月14 日 P 23 62 353.2 昭和 49 年 112 113 日 特許庁長官殿 1. 発明の名称 半導体系子の冷却体 2. 発 IJ 岩 Ð: 197 西ドイツ国エルランゲン、エスキルシュトゥンナ シユトラーセ、25 ĸ 名 ヴエルナー、ハングス (ほか 名) 3.特許出願人 Œ. 所 西ドイツ国ペルリン及びミユンヘン(番地なし) シーメンス・アクチエンゲゼルシャフト 4, 称 代表者 ヘルマン、レンカー ウィリー、プライが式 代表者 (HII) 14 轿 西ドイツ国 能在 4. (0 玔 人 川崎市川崎区田辺新田1番1号 (注 所 富士電機製造株式会社內 色學編 氏 8 (7516) 弁理士 山 口 Tel. (044) 333-7111 (内線393) 5. 添付書類の目録

(1) 明 (2) 図

亚 . 面

特許庁 49.12.16 (3) 委任状及び訳文

(4) 優先権証明群及び訳文「強って補えてる。

49 14400i

1 通

1 通

l in

l in

詽 欿

1. 発明の名称 半導体累子の冷却体

2. 特許請求の範囲

一端面に半導体業子が固定される柱状の中実芯 節を有し、その互に向い合う両側面から冷却フィ ンが側方に張り出し、その増部が相互にそして芯 部の長手曲に対して平行な2つの平面まで延びて いるものにおいて、冷却フィンの少なくとも一部 -が 芯部の長手軸に対 して傾斜しそして冷却フィン のフインの頂きが、 半導体衆子を固定するために 用いられる端面の方向に向つて放少することを特 敬とする半導体器子の冷却体。

3. 弱明の辞細を説明

年発明は、一路面に 半導体素子が固定される柱 状の中央芯部を有し、その互に向い合う両側面か ら冷却フィンが何方に張り出し、その端部が相互 にそして芯鉛の長手軸に対して平行を2つの平面 まで延びている半導体ネ子の冷却体に関する。

このような冷却体は、例えば近ドイツ国際許出 戯公開第 1913546 号公報ないし Assmann & 8chone

公開特許公報

①特開昭 50-94884

30公開日 昭 50.(1975) 7 28

3)特願昭 49 - 144001

20出願日 四49. (1974) 12.13

審査請求 未請求

(全4 頁)

庁内整理番号 7021 57

6758 32

20日本分類 995C4 69 C2

(1) Int. C12 HOIL 23/34/ F28F /3/00

どのカタログ * Elektronische Bauelemente 1971* K こり公知である。

この公知の立方体状をなす舟却体は、北子袋は 乃に小さな占有空間をもつて設置される。このこ とは、なかんずく、世子要世内に、例えばサイリ スタ変換ユニット内に多くの半導体宏子を相並べ て配趾するときに重要である。しかしながら、公 豆の冷却体にないては、冷却体の数も高温の個所、 即ち半導体案子を固定するために用いられる 強面 正傍の冷却フィンが、冷却体のより低温の個所に 位置する冷却体より短かいか最大でも同じ長さで るるという欠点がある。この結果、熱放飲に役立 つ、冷却体の最高温の個所のそれ故にその熱源の 元傍にかける袋面積は最少である。 公知の冷却体 は、従つて熱放散に対して吸適であるとは貫えな 100

上記のカタログによつて、板状の基台から放射 スに冷却フィンを張り出させた心却供も公知であ る。この冷却体は、ファン袋俊のために用意され ている。半導体架子を恰却するためには、とのフ

: いつのは、冷却フィンが側方に大きく災出して ・り、ために電子感覚の占有空間の小さな解成が 、可能だからである。

本発明の目的は、堤初に述べた形式の合却体を に良し、立方体状の形態を保持したまま熱放散を を適化することにある。

この目的は、本発明によれば、冷却フィンの少さくとも一部を芯部の長手軸に対して傾斜させそ して冷却フィンの傾きを、半導体素子を固定する こめに用いられる増面の方向に向つて減少させる ことで達成される。

特に、合却体の最も高温である範囲内にかいて 分却フィンが互に異なる傾きを持つようにするこ とにより、作却フィンの長さを、最高温の個所の 通囲内にかいても全く短縮させずそしてそれ故と の個所の冷却フィンの面機を冷却体のより低温の 当所にかけるそれと少なくとも等しくすることが 可能である。これに伴つて冷却体の立方体状をな す形態が損われることはなくそして芯部も同様に、

- 3 -

雄状にすれば、材料を大幅に節約できる。 芯部 2 から領方に張り出している冷却フィン3は、部分 的に、芯部2の長手軸に対して傾いている。各層 却フイン3の中心面3 aが長手軸7となす角度α は、 架子のための穴 5 を 備える 端面 4 の 方向 に向 うに従い小さくなつている。 冷却フィン 3 の傾き 即ち各冷却フインの角度αは、冷却フィンが穴 5 の延びる範囲内、即ち冷却体1の最も高温の範囲 刃において、冷却体1の自由端にあるそれより長 くなるよりに退ばれている。との結果、熟放散に 役立つ表面積は、冷却体1の最も高温である個所 にかいて増大しこれに伴い熱放散を最適化しそし て冷却体1の形状を直方体状に保つことができる。 というのは、全冷却フィン3の媚部を、解1図に **弦線で示した、相互にそして中心軸7に対して平** 行な2つの面8と9より外方に延びないようにし ているからである。

志部2の側面2 a から側方に延びるようにして 突起 10.11 を改け、芯部 2 の広い端面 4 を一層広 くしてある。上記の突起 10.11 は冷却フィンを担 円錐状とすることができる。 従つて、 本発明による 冷却体は大きな 空間を占めることなく 狙込まれ そして その熱放散は最適化される。

芯部から直接扱り出している全ての冷却フィンの傾さを、冷却フィンの投さが、半導体業子を固定するために用いられる端面の方向に同つて増大するように現定するのが望ましい。この好適な構成形態の場合、熱放散に有効な表面機を熱源の近傍において最大にすることができる。

以下本発明を図示の実施例について詳しく説明・する。

第1図は、本発明による冷却体の平面図である

志部2は、円錐状ををす2つの側面2aを有し、
これから冷却フィン3が側方に延びている。 芯部
2の広い方の端面4に、 熟源である半導体 紫子、
例えばサィリスタをねじ込むための穴5が設けて
ある。 熟確量が芯部3の自由端6に向つて減少して行くことから、 芯部を円錐状になすことは 熱症
のために好適である。さらに、中央の芯部2を円

-4-

持する。 との 突起 10.11 に、 この 突施例の場合、 それぞれ 2 個の 冷却フィン 1 2 を 設けて かり 気を 2 の 気が 2 から 延び でいる 冷却フィン の 傾き と同じかより 大きく 選んである。 この 冷却フィン 1 2 によって、 熱 爾 の 近 が 満 た され、 そして かっているの 突起 は 冷却体 1 を 節定する ために かい で は、 突起 1 0 と 1 1 に 各々 下字状 断面 の 都 1 0 a と 1 1 a を 設けでいる。

第1図に示す冷却体の場合、自由端6に成も近い冷却フィン3が90°の角度を持つて扱り出しそして芯部1の狭い端面6にも同じくT形断面の存13が設けられている。互に平行に延びる存10a.11aかよび13を利用することにより、本発明による冷却体1を簡単な方法で固定ねじを用いて固定することができ、この場合許容誤差について考以する必要はなくそして特別の孔を冷却体に設けずともよい。

ミーソーにほグシが虫ェレバ。 しょうればいれエ 並に好適であり、特に経済的である。

第2 凶は、本発明による冷却体を用いることで、 **最適の熟放散を行いつつ占有空間の小さな電子要** 健、例えばサイリスタ変換ユニットを実現できる ことを示す。 442 図は電子装置の断面図である。 第1図示の冷却体1は、前面板14と組立て板15 ・の間に相並べて配配されている。 前面板14と組 立て板 1.5 は 質 気 絶 録 性 の 材 科 か ら な る 。 前 面 板 14と、各冷却体がねじ16を用いてねじ結合し ており、そのナット17はそれぞれ得10aたいし 112内に固定されている。祖立て板15上に各冷 却体1の自由端面6が接しそして同様に、それぞ れねじ18を用いてねじ止めされており、そのナ ツト19は各冷却体1の襷13内に配置されてい る。とのような固定方法によれば許容誤差の補償 が不要であり、そして冷却体 1 に組立て時特別の 穴を設ける必要がないことは直ちに明白である。 各冷却体1の穴5内に、それぞれ半導体紫子20

-7-

ずに製造できそしてそれ故コスト的に使れた装置 を存成するのに適する。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明一実施例の平面図、第2図は第1図に示す冷却体を用いた装置の断面図である。 1 … 冷却体、2 … 芯部、2 a … 側面、3 … 冷却 フイン、4.6 … 端面、7 … 芯部の長手軸、8.9 … … 平面。

化型人种理士 山 口 凝

であった。 これら各半導体累子 2 0 は、前面板 1 4 の開口 2 1 を通つて突出しそしてこれに伴い常に外部から手を触れることができる。この結果保守の容易な構造を持つ電子装置が得られる。

以上契約するに、本発明による冷却体を用いることで、被適の熱放散を行いつつ電子装置の占有空間の小さな裸成を実現することができ、このときさらに、狙立てをきわめて簡単化することができる。本発明による冷却体は、特別の費用を要せ

-8-



